

2008年度 サマーキャンプ/研究見学会のご案内

目的: CMP技術の基礎を理解することを目的に、チュートリアル形式で講義する。

日時: 2008年8月27日(水), 28日(木)

宿泊先: 西条HAKUWAホテル
 (JR西条駅よりバスで15分、広島空港よりタクシーで35分)
 〒739-0047 東広島市西条下見6-5-45
 Tel. 082-431-1111 Fax. 082-431-4455

見学先: 広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所

参加費: ■Aコース:(8/27-28日) 39,000円
 ■Bコース:(8/26-28日) 47,000円

※費用にはサマーキャンプ・見学会参加・懇親会費が含まれます。
 尚1人部屋ご希望の場合、上記費用に2000円を加算させていただきます。
 また、状況により、ご希望に添えない場合もございますので、ご了承いただけますようお願いいたします。

▼スケジュール

8月27日(水)	
9:30-	開講の辞
10:00-11:00	講義 1: 超LSIプロセスと最新のCMP技術 山田洋平(日立製作所)
11:00-12:00	講義 2: CMPにおける材料除去メカニズム 木村景一(九州工業大学)
12:00-13:00	昼食
13:00-14:00	講義 3: CMP装置 檜山浩國(荏原総合研究所)
14:00-15:00	講義 4: CMPにおけるポリッシングパッドとスラリー 磯部 晶(ニッタ・ハース)
15:00-15:30	コーヒーブレイク
15:30-16:30	講義 5: CMPにおける洗浄技術 河瀬康弘(三菱化学)
16:30-17:30	講義 6: CMPにおける計測技術 (未定)
17:30-18:30	講義 7: 半導体業界とCMP産業の動向 武野泰彦(グローバルネット)
18:30-19:30	休憩(入浴など)
19:30-	夕食・懇親会
8月28日(木)	
朝食後	広島大学 ナノデバイス・バイオ融合科学研究所見学
10:00-11:00	ナノデバイス・バイオ融合科学研究所見学
11:00-12:00	講演(吉川公磨/広島大学教授)
12:00-12:30	閉校式後解散

(敬称略)